

高濃度オゾン水供給装置 OZW-ODM series

小型で高濃度のオゾンガスを発生するOZS(HC-70)シリーズから高濃度オゾンガスをオゾン溶解膜モジュール (Ozone Dissolution Membrane) に供給することで、高濃度オゾン水を生成することができます。

オゾン用溶解膜モジュールや配管を始め接水部は全てPTFE製ですので、純水を供給することで非常にクリーンな高濃度オゾン水を生成することが可能です。

主として半導体製造などわずかな汚染が問題となるプロセスの洗浄に使用することができます。

製品例
OZW-ODM-0.1/20



オゾン溶解膜モジュールの特徴

- ① チューブ状延伸PTFE(100%)多孔膜溶解方式を採用
- ② チューブ膜の微小孔径化による耐水圧レベルアップ
→ 仕様範囲内(最大0.3MPa)で安定した溶解濃度
- ③ コンパクトで高濃度を実現
- ④ シンプルな製造方法
→ 個体差が少なく品質安定

OZW-ODM-0.1/20 仕様

超純水流量	50 ~ 300 ml/min
酸素ガス流量	50 ~ 300 ml/min
オゾン水流量	50 ~ 300 ml/min (純水流量とほぼ同量)
オゾンガス濃度	200 Ng/m ³ 以上
オゾン水濃度	20 mg/l 以上 (仕様値) 40 mg/l 以上 (実測値 ;100 ml/min の場合)

使用したオゾン溶解膜の溶解条件

超純水流量	1 l/min
水温	25 °C
オゾンガス濃度	270 Ng/m ³
オゾンガス圧	大気圧
溶存オゾン濃度	35 mg/l 以上



株式会社 増田研究所

〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-11 かねやすビル6

Tel: 03-3818-0472 Fax: 03-3818-9818

E-mail: info@masuda-research.co.jp

Home Page: <http://www.masuda-research.co.jp>